Docket No. 246598US3

## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Tetsushi KAWAMURA, et al.			GAU:		
SERIAL NO:NEW APPLICATION			EXAMINER:		
FILED:	HEREWITH				
FOR:	PRESSURE SENSOR			•	•
		REQUEST FOR PRIO	RITY		
	SIONER FOR PATENTS DRIA, VIRGINIA 22313				
SIR:					
☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number provisions of <b>35 U.S.C. §120</b> .			, filed	, is claimed purs	uant to the
□ Full be §119(e		U.S. Provisional Application(s) i <u>Application No.</u>	is claimed pu <u>Date Fil</u>		ons of 35 U.S.C.
Application the pro-	cants claim any right to prior ovisions of 35 U.S.C. §119, a	ity from any earlier filed applicates noted below.	tions to which	h they may be entitle	ed pursuant to
In the matt	ter of the above-identified ap	plication for patent, notice is her	eby given tha	at the applicants clai	m as priority:
COUNTR Japan	<u>RY</u>	APPLICATION NUMBER 2002-364414		ONTH/DAY/YEAR cember 16, 2002	<u> </u>
Certified c	copies of the corresponding C	Convention Application(s)			
are	submitted herewith		ı		
□ wil	ll be submitted prior to paym	ent of the Final Fee			
	re filed in prior application S				
Re	ere submitted to the Internation ceipt of the certified copies be knowledged as evidenced by	onal Bureau in PCT Application by the International Bureau in a t the attached PCT/IB/304.	Number imely manne	r under PCT Rule 1	7.1(a) has been
□ (A	) Application Serial No.(s) w	vere filed in prior application Ser	ial No.	filed ; and	
□ (B	) Application Serial No.(s)				
{	are submitted herewith				
ſ	☐ will be submitted prior to	payment of the Final Fee			
			Respectfully	Submitted,	
			OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.		
			(Jm)	Milland	
Customer Number			Registration No. 21,124		
228	350		_		

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 05/03)

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年12月16日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-364414

[ST. 10/C]:

[ J P 2 0 0 2 - 3 6 4 4 1 4 ]

出 願 人
Applicant(s):

豊田工機株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年 9月17日





ページ: 1/E

【書類名】

特許願

【整理番号】

PN0446

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01L 29/84

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県刈谷市朝日町1丁目1番地 豊田工機株式会社内

【氏名】

川村 哲司

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県刈谷市朝日町1丁目1番地 豊田工機株式会社内

【氏名】

山川 知也

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県刈谷市朝日町1丁目1番地 豊田工機株式会社内

【氏名】

鈴木 一志

【特許出願人】

【識別番号】

000003470

【氏名又は名称】 豊田工機株式会社

【代理人】

【識別番号】

100109069

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 敬

【電話番号】

052-218-9077

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

053729

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

## 【書類名】明細書

【発明の名称】

圧力センサ

【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

圧力を検知可能な半導体素子と、該半導体素子とボンディングワイヤで結ばれるターミナルと、該半導体素子、該ボンディングワイヤ及び該ターミナルを収納する収納空間を有するハウジングと、該収納空間を封止するダイヤフラムと、該収納空間に封入され、該ダイヤフラムの受ける圧力を該半導体素子に伝達する作動流体とを備えた圧力センサにおいて、

前記作動流体はシリコーン系オイルであり、前記ターミナルと前記ハウジング とはフッ素系接着剤により封止されていることを特徴とする圧力センサ。

## 【請求項2】

圧力を直接検知可能な半導体素子と、該半導体素子とボンディングワイヤで結 ばれるターミナルと、該半導体素子、該ボンディングワイヤ及び該ターミナルを 収納する収納空間を有するハウジングとを備えた圧力センサにおいて、

前記ターミナルと前記ハウジングとはフッ素系接着剤により封止されていることを特徴とする圧力センサ。

#### 【請求項3】

フッ素系接着剤はパーフロロポリエーテル樹脂組成物であることを特徴とする 請求項1又は2記載の圧力センサ。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は圧力センサに関する。

[0002]

#### 【従来の技術】

従来、特許文献1記載の圧力センサが知られている。この圧力センサは、圧力 を検知可能な半導体素子と、この半導体素子とボンディングワイヤで結ばれたタ ーミナルと、半導体素子、ボンディングワイヤ及びターミナルを収納する収納空 間を有するハウジングと、収納空間を封止するダイヤフラムと、収納空間に封入され、ダイヤフラムの受ける圧力を半導体素子に伝達する作動流体とを備えている。作動流体としてはパーフルオロポリエーテルからなるフッ素系オイルが使用されている。この種の圧力センサでは、一般的にターミナルとハウジングとの封止のためにシリコーン系接着剤が使用されている。

## [0003]

かかる圧力センサでは、検知しようとする圧力がダイヤフラムに作用すると、ダイヤフラムが変形し、作動流体によってその圧力が半導体素子に伝達される。 半導体素子はその圧力を検知し、その信号は、ボンディングワイヤを介してターミナルに送信され、ターミナルによって他の機器に送信される。この際、この圧力センサでは、作動流体としてのフッ素系オイルが良好な圧力伝達性を保つ一方、フッ素化合物とシリコーン化合物との特性からシリコーン系接着剤の膨潤が防止されている。こうして、この圧力センサでは、シリコーン系接着剤の接着力の低下を防止してターミナルとハウジングとの封止を保ち、耐久性も発揮している。

#### $[0\ 0\ 0\ 4\ ]$

また、特許文献 2 記載の圧力センサも知られている。この圧力センサは、圧力を直接検知可能な半導体素子と、この半導体素子とボンディグワイヤで結ばれるターミナルと、半導体素子、ボンディングワイヤ及びターミナルを収納する収納空間を有するハウジングとを備えており、上記のようなダイヤフラムを備えていない。そして、半導体素子、ボンディングワイヤ及びターミナルは収納空間に充填された作動流体としてのフッ素系ゲルに埋没され、さらにターミナルとハウジングの上方がフッ素系接着剤で被覆されている。

## [0005]

この圧力センサでは、検知しようとする圧力がフッ素系ゲル表面に作用すると、フッ素系ゲルによってその圧力が半導体素子に伝達される。半導体素子はその圧力を検知し、その信号は、ボンディングワイヤを介してターミナルに送信され、ターミナルによって他の機器に送信される。この際、この圧力センサでは、フッ素系ゲル及びフッ素系接着剤がガソリン蒸気、水蒸気等に曝されることによる

耐久性を発揮している。

[0006]

【特許文献1】

特許2819783号公報

[0007]

【特許文献2】

特開2001-99737号公報

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、上記特許文献1記載の圧力センサでは、高価なフッ素系オイルを作動 流体として使用しているため、フッ素系オイルの使用量が多く、製造コストの高 騰化を招いていた。この点、作動流体としてフッ素系オイルの替わりに安価なシ リコーン系オイルを使用するとすると、ターミナルとハウジングともシリコーン 系接着剤により封止されていることから、シリコーン系樹脂同士の特性により、 シリコーン系接着剤が膨潤して接着力の低下を生じ、ターミナルとハウジングと の封止が十分でなくなり、耐久性が懸念される。

[0009]

また、特許文献2記載の圧力センサでは、フッ素系ゲルとともにフッ素系接着 剤を外部からの保護のために用いており、やはり製造コストの高騰化を招いてい た。

[0010]

本発明は、上記従来の実情に鑑みてなされたものであって、感度よく圧力を検知することができ、かつ製造コストの低廉化を実現することができる圧力センサを提供することを解決すべき課題としている。

 $[0\ 0\ 1\ 1]$ 

【課題を解決するための手段】

第1発明の圧力センサは、圧力を検知可能な半導体素子と、該半導体素子とボンディングワイヤで結ばれるターミナルと、該半導体素子、該ボンディングワイヤ及び該ターミナルを収納する収納空間を有するハウジングと、該収納空間を封

止するダイヤフラムと、該収納空間に封入され、該ダイヤフラムの受ける圧力を 該半導体素子に伝達する作動流体とを備えた圧力センサにおいて、

## [0012]

前記作動流体はシリコーン系オイルであり、前記ターミナルと前記ハウジング とはフッ素系接着剤により封止されていることを特徴とする。

## [0013]

第1発明の圧力センサでは、検知しようとする圧力がダイヤフラムに作用すると、ダイヤフラムが変形し、作動流体によってその圧力が半導体素子に伝達される。半導体素子はその圧力を検知し、その信号は、ボンディングワイヤを介してターミナルに送信され、ターミナルによって他の機器に送信される。この際、この圧力センサでは、作動流体としてのシリコーン系オイルが良好な圧力伝達性を保つ。また、近年のフッ素系接着剤は接着能力が著しく向上している。そして、従来と同様、シリコーン化合物とフッ素化合物との特性からフッ素系接着剤の膨潤が防止される。こうして、この圧力センサでは、フッ素系接着剤の低下を防止してターミナルとハウジングとの封止を保ち、耐久性も発揮している。また、シリコーン系オイルはフッ素系オイルに比べ安価であるため、作動流体として大量に使用されても、製造コストの高騰化を生じない。

## [0014]

第2発明の圧力センサは、圧力を直接検知可能な半導体素子と、該半導体素子とボンディングワイヤで結ばれるターミナルと、該半導体素子、該ボンディングワイヤ及び該ターミナルを収納する収納空間を有するハウジングとを備えた圧力センサにおいて、

#### [0015]

前記ターミナルと前記ハウジングとはフッ素系接着剤により封止されていることを特徴とする。

#### [0016]

第2発明の圧力センサでは、検知しようとする圧力が直接半導体素子によって 検知され、その信号は、ボンディングワイヤを介してターミナルに送信され、タ ーミナルによって他の機器に送信される。この際、この圧力センサでは、接着能 力が著しく向上したフッ素系接着剤だけでターミナルとハウジングとを封止しており、作動流体を備えていないため、製造コストの低廉化を実現できる。

#### $[0\ 0\ 1\ 7]$

したがって、第1発明及び第2発明の圧力センサによれば、感度よく圧力を検 知することができ、かつ製造コストの低廉化を実現することができる。

#### [0018]

発明者らの試験結果によれば、第1発明及び第2発明の圧力センサは、フッ素 系接着剤がパーフロロポリエーテル樹脂組成物であることが好ましい。パーフロロポリエーテル樹脂組成物は、(A)分子中にアルケニル基を有すると共に、主鎖中にパーフロロポリエーテル構造を有する直鎖状フロロポリエーテル化合物、

(B) 分子中に珪素原子に結合した水素原子を有する含フッ素有機珪素化合物及び(C) 白金族化合物とからなる硬化性樹脂組成物であることが好ましい。かかるフッ素系接着剤は、例えば、特開平9-95615号公報に記載されている。

#### [0019]

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明を具体化した実施形態1、2を図面を参照しつつ説明する。

#### [0020]

#### (実施形態1)

実施形態1の圧力センサは、図1に示すように、ハウジング3とダイヤフラム8と作動流体9とを備えている。ハウジング3は例えばPPS(ポリフェニレンサルファイド)製の第1ハウジング1と、この第1ハウジング1の一端側の外周に設けられた鋼製の第2ハウジング2とからなる。第1ハウジング1の一端側は第2ハウジング2とともに収納空間4を形成しており、この収納空間4は第1ハウジング1と第2ハウジング2との間に挟持されたダイヤフラム8により封止されている。また、第1ハウジング1の他端側には、外部と電気的に接続するためのコネクタ1 aが形成されている。第2ハウジング2の一端側には被検知物質11をダイヤフラム8側に導入する導入孔2 aが貫設されており、他端側が第1ハウジング1に対してかしめられている。そして、収納空間4にはシリコーン系オイルである作動流体9が封入されている。

## [0021]

収納空間4には、図2に示すように、圧力を検知可能な半導体素子5と、半導体素子5とボンディングワイヤ7で結ばれるターミナル6とが収納されている。 半導体素子5は第1ハウジング1に接着されている。また、ターミナル6は、図1に示すように、第1ハウジング1を貫通して設けられ、一端が収納空間4に突出し、他端がコネクタ1a内に突出している。このターミナル6は、図2に示すように、その先端がフッ素系接着剤10により第1ハウジング1に封止状態で一体的に接着されて、ターミナル6と第1ハウジング1との微小な隙間からの作動流体の洩れが防止されている。本実施形態においては、フッ素系接着剤10として、パーフロロポリエーテル樹脂組成物(信越化学工業株式会社製SIFEL614)を採用している。

## [0022]

以上の構成をした圧力センサでは、ダイヤフラム 8 が第 2 ハウジング 2 の導入 孔 2 a から導入された被検知物質 1 1 の圧力を受け、この圧力を作動流体 9 が半 導体素子 5 に伝達する。そして、半導体素子 5 により圧力が電気信号に変換され る。この電気信号は、ボンディングワイヤ 7 及びコネクタ 1 a のターミナル 6 を 介して外部に取り出される。

### [0023]

この際、この圧力センサでは、作動流体9としてのシリコーン系オイルが良好な圧力伝達性を保つ。また、フッ素系接着剤10は良好な接着能力を発揮する。そして、シリコーン化合物とフッ素化合物との特性からフッ素系接着剤10の膨潤が防止される。こうして、この圧力センサでは、フッ素系接着剤10の接着力の低下を防止してターミナル6と第1ハウジング1との封止を保ち、耐久性も発揮している。また、シリコーン系オイルはフッ素系接着剤10に比べ安価であるため、作動流体9として大量に使用されても、製造コストの高騰化を生じない。

#### [0024]

したがって、実施形態1の圧力センサによれば、感度よく圧力を検知することができ、かつ製造コストの低廉化を実現することができる。

#### [0025]

## (実施形態2)

実施形態2の圧力センサは、図3及び図4に示すように、圧力を直接検知可能な半導体素子5と、収納空間24を有するハウジング23とを備えている。収納空間24内には半導体素子5、ボンディングワイヤ7及びターミナル6が収納されている。ハウジング23は例えばPPS(ポリフェニレンサルファイド)製の第1ハウジング21と、この第1ハウジング1の一端側の外周に設けられた鋼製の第2ハウジング22とからなる。第1ハウジング21の一端側が第2ハウジング22とともに収納空間24を形成している。また、第1ハウジング21の他端側には、外部と電気的に接続するためのコネクタ21aが形成されている。第2ハウジング22の一端側には被検知物質11を導入する導入孔22aが貫設されており、他端側が第1ハウジング21に対してかしめられている。収納空間24と導入孔22aとは連通している。

## [0026]

半導体素子5は第1ハウジング21に接着されている。また、ターミナル6は第1ハウジング21を貫通して設けられ、一端が収納空間24に突出し、他端がコネクタ21a内に突出している。このターミナル6はフッ素系接着剤10により第1ハウジング21に接着されている。本実施形態においても、フッ素系接着剤10として、パーフロロポリエーテル樹脂組成物(信越化学工業株式会社製SIFEL614)を採用している。

### [0027]

以上の構成をした圧力センサでは、第2ハウジング22の導入孔22aから導入された被検知物質11の圧力が直接、半導体素子5に伝達される。そして、半導体素子5により圧力が電気信号に変換される。この電気信号は、ボンディングワイヤ7及びコネクタ21aのターミナル6を介して外部に取り出される。

#### [0028]

この際、この圧力センサでは、接着能力が著しく向上したフッ素系接着剤10 だけでターミナル6と第1ハウジング21とを封止しており、このフッ素系接着 剤10の封止機能でターミナル6と第1ハウジング21との間の微小な隙間から の検出流体の洩れが確実に防止でき、しかも作動流体を備えていないため、製造 コストの低廉化を実現できる。

## [0029]

したがって、実施形態2の圧力センサによっても、感度よく圧力を検知することができ、かつ製造コストの低廉化を実現することができる。また、この圧力センサは、ダイヤフラムも備えていないため、さらに製造コストの低廉化を実現することができる。

## 【図面の簡単な説明】

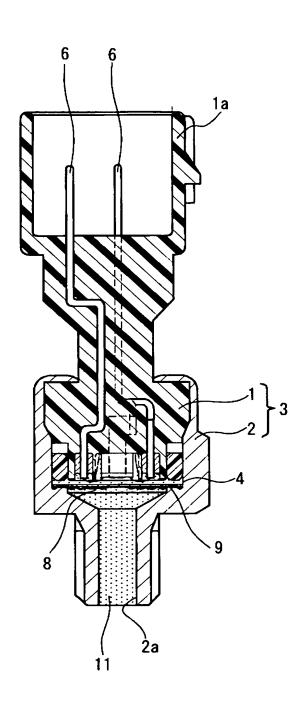
- 【図1】実施形態1の圧力センサの断面図である。
- 【図2】実施形態1の圧力センサの拡大断面図である。
- 【図3】実施形態2の圧力センサの断面図である。
- 【図4】実施形態2の圧力センサの拡大断面図である。

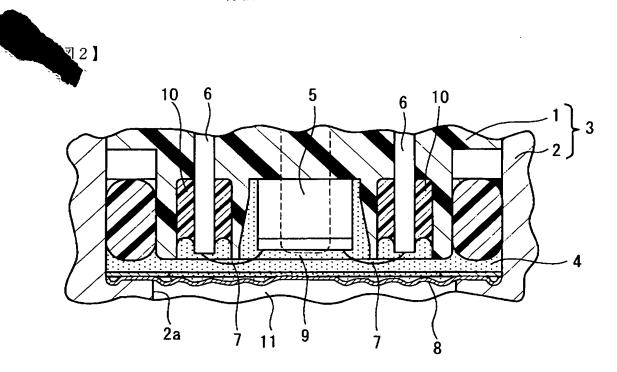
### 【符号の説明】

- 3、23…ハウジング
- 5 … 半導体素子
- 6…ターミナル
- 7…ボンディングワイヤ
- 4、24…収納空間
- 8…ダイヤフラム
- 9…作動流体
- 10…フッ素系接着剤

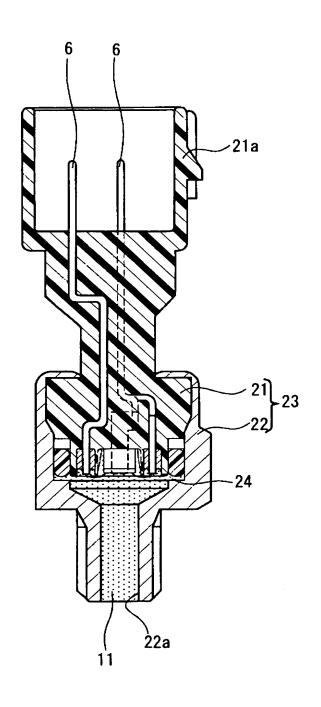


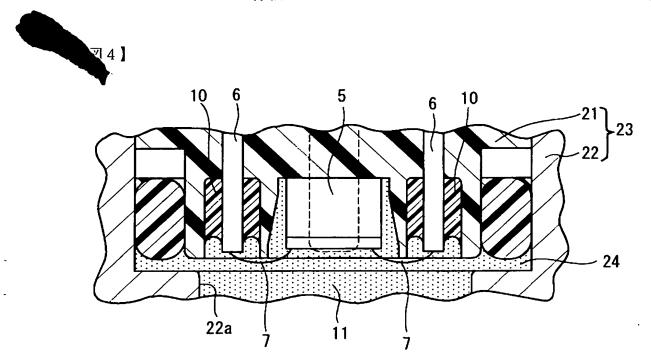
図面











專類名】

要約書

[要約]

【課題】感度よく圧力を検知することができ、かつ製造コストの低廉化を実現することができる圧力センサを提供する。

【解決手段】圧力を検知可能な半導体素子5と、半導体素子5とボンディングワイヤ7で結ばれるターミナル6と、半導体素子5、ボンディングワイヤ7及びターミナル6を収納する収納空間4を有するハウジング3と、収納空間4を封止するダイヤフラム8と、収納空間4に封入され、ダイヤフラム8の受ける圧力を半導体素子5に伝達する作動流体9とを備えている。作動流体9はシリコーン系オイルであり、ターミナル6とハウジング3とはフッ素系接着剤10により封止されている。

【選択図】

図 1

## 認定・付加情報

特許出願の番号 特願 2 0 0 2 - 3 6 4 4 1 4

受付番号 50201905139

書類名 特許願

担当官 第五担当上席 0094

作成日 平成14年12月17日

<認定情報・付加情報>

**【提出日】** 平成14年12月16日



## 特願2002-364414

## 出願人履歴情報

識別番号

[000003470]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名 1990年 8月24日 新規登録 愛知県刈谷市朝日町1丁目1番地 豊田工機株式会社